

F3

薄膜厚度测量仪



经济适用的反射率测试系统

F3 系统是专门为采集反射率光谱曲线设计的，并且可选配至厚度和指数测试功能基本通用型拥有 40000 个小时适用寿命的光源及自动波长校准，大大提高了测试准确度。

快速厚度测试

升级厚度测试软件许可后，厚度值将在测试数据结果中直观的显示。软件中存入了常用的介质材料及半导体层的光学常数。

指数测试功能 (n 和 k)

对于更高级用户来说，指数测试软件升级能在短时间内提供折射率和消光系数。

相关应用

半导体制造

- 光刻胶
- 氧化物
- 氮化物

光学镀层

- 硬涂层
- 抗反射层
- 滤光器

液晶显示器

- 盒厚
- 聚酰亚胺
- ITO

生物医学

- 聚对二甲苯
- 生物膜
- 消化纤维

Filmetrics 的优势

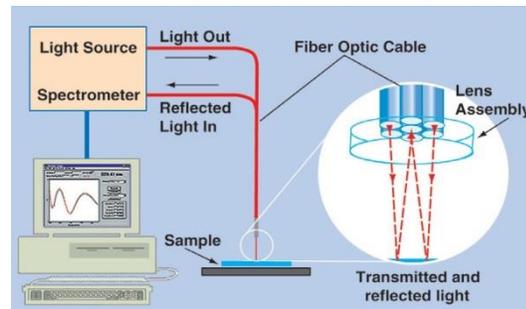
- 桌面型薄膜厚度测量的全球领导者
- 24 小时电话, Email, 在线支持
- 直观的分析软件

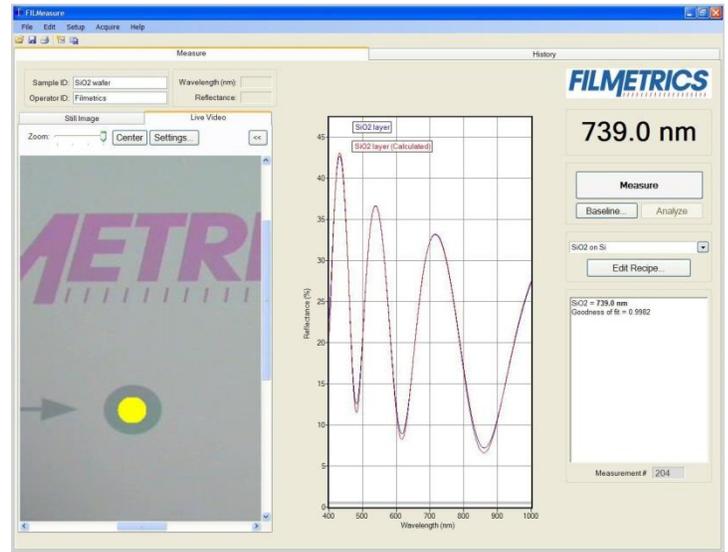
附加特性

- 嵌入式在线诊断方式
- 免费离线分析软件
- 精细的历史数据功能，帮助用户有效的存储，重现与绘制测试结果

免费现场演示/支持

点几下鼠标就可以在网络上在线看到现场演示！请联系我们，我们的应用工程师会在电脑上为您演示薄膜测量是多么容易！





选配样品摄像功能的 FILMeasure™ 软件

	F3-UV	F3	F3-NIR	F3-XT	F3-XXT
厚度测量范围*:	3 nm - 40 μm	15 nm - 70 μm	100 nm - 250 μm	0.2 μm - 450 μm	5 μm - 3 mm
测量 n 和 k 值厚度要求*:	50 nm	100 nm	500 nm	2 μm	100 μm
准确度*: 大于 0.4%或	1 nm	2 nm	3 nm	5 nm	50 nm
精度 ¹ :	0.1 nm	0.1 nm	0.2 nm	1 nm	5 nm
稳定性 ² :	0.07 nm	0.07 nm	0.12 nm	1 nm	5 nm
斑点尺寸:	标准 1.5 mm, 可选配至 20 μm			600 μm	25 μm
样品尺寸:	直径从 1 mm to 300 mm 或更大				
光源	氙灯 2000hr, 钨卤灯 1200 hr	40,000 hr			>10 年
光谱仪					
波长范围:	200 - 1100 nm	380 - 1050 nm	950 - 1700 nm	1440 - 1690 nm	1520 - 1580 nm

基本要求	
电源:	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 0.3 - 0.1 A
接口:	USB 2.0
认证:	CE EMC 和欧洲安全认证
操作系统	
PC:	Windows XP(SP2) - Windows 8(64-bit)
Mac:	OS X Lion/Mountain Lion

* 取决于材料

¹ 标准偏差为一天内在 Si 基底上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度值的标准偏差。该值为连续 20 天测量的标准偏差值的平均值。

² 2σ 是基于连续 20 天, 每天在基底上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度值上得出。



优尼康科技有限公司

– Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改, 恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc